

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
24 mars 2005 (24.03.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2005/026838 A2

(51) Classification internationale des brevets⁷ : **G03F 7/00**

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2004/050433

(22) Date de dépôt international :
15 septembre 2004 (15.09.2004)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
03 50561 17 septembre 2003 (17.09.2003) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : **COM-
MISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR];**
31-33 rue de la Fédération, F-75752 PARIS 15ème (FR).

(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant (pour US seulement) : **GUIBERT,
Jean-Charles [FR/FR];** 4, Beau Rivoire, F-38960 SAINT
ETIENNE DE CROSSEY (FR).

(74) Mandataire : **POULIN, Gérard; BREVATOME,** 3, rue
du Docteur Lancereaux, F-75008 PARIS (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,
MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH,
PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),
européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI,
SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

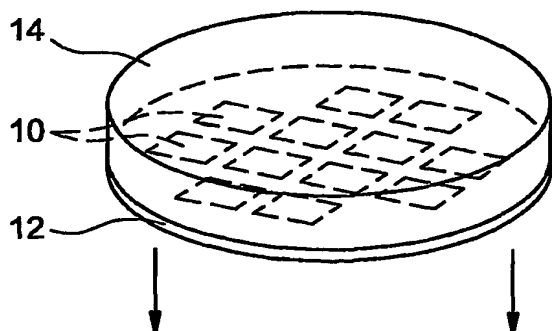
Publiée :

— sans rapport de recherche internationale, sera republiée
dès réception de ce rapport

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abrévia-
tions, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et
abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de
la Gazette du PCT.

(54) Title: MICROLITHOGRAPHY METHOD USING A MASK WITH CURVED SURFACE

(54) Titre : PROCEDE DE MICRO-LITHOGRAPHIE UTILISANT UN MASQUE A SURFACE COURBE



(57) Abstract: The invention concerns a method for preparing a
lithography mask, comprising: a step which consists in providing
patterns (10) on a planar substrate (12), a step which consists in
transferring the patterns onto a support (16) having a non-null
curvature in at least one point of its surface.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de préparation d'un
masque de lithographie, comportant : une étape de réalisation de mo-
tifs (10) sur un substrat plan (12), une étape de report des motifs sur
un support (16) ayant une courbure non nulle en au moins un point de
sa surface.

WO 2005/026838 A2